## Design and Fabrication of Flexible Graphene Electrode with Visible Laser

Hedieh Pazokian<sup>\*1</sup>, Maryam Bahreini<sup>2</sup>and Fateme Rajabi<sup>3</sup>

## Abstract

In this paper, the fabrication of graphene electrodes on Polyimide film with laser induced graphene phenomenon was investigated. For this purpose, a visible laser with a wavelength of 445 nm was used to create graphene on the surface. The formation of the graphene on the surface following irradiation was tested by Raman spectroscopy and X-ray diffraction of the irradiated sample. An electrical multimeter and a scanning electron microscope were used to investigate the effect of irradiation parameters such as laser power, laser irradiated lines overlapping, and laser scanning velocity on the electrical resistance and the surface morphology, respectively. The results indicate the formation of porous graphene with different structures on the surface by the laser laser-induced graphene phenomenon. The minimum electrical resistance of ~80 ohms was achieved with a specific irradiation condition. However, surface morphology is an important parameter affecting the quality of the electrodes in many applications, such as energy storage devices. According to this research, the irradiation conditions should be optimized for the formation of an electrode for the desired application.

Keywords: Laser Induction, Graphene Electrode, Polyimide, Visible Laser

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Associate Professor, Photonics and quantum technologies research school, Nuclear science and technology research institute, Tehran, Iran. (Corresponding Author)(Email: <u>hpazokian@aeoi.org.ir</u>)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Assistant Professor, Physics department, Iran university of science and technology, Tehran, Iran. (Email: <u>m.bahreini@iust.ac.ir</u>)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>PhD Student, Physics department, Iran university of science and technology, Tehran, Iran. (Email: <u>fatemeh.rajabi7979@gmail.com</u>)

طراحي و ساخت الكترودهاي انعطاف يذير گرافني با تابش ليزر مرئي هديه پازكيان'، مريم بحريني'، فاطمه رجبي" در این مقاله ساخت الکترود گرافنی بر روی فیلم پلی ایمید با پدیده القای لیزری گرافن مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور از لیزر مرئی با طول موج ۴۴۵ نانومتر برای ایجاد گرافن در سطح استفاده شد. تشکیل گرافن بر روی سطح پس از تابش با استفاده از طیف سنجی رامان و پراش اشعه ایکس نمونه تابیده شده مورد آزمایش قرار گرفت. یک مولتیمتر الکتریکی و یک میکروسکوپ الکترونی روبشی برای بررسی اثر کمیت های تابش مانند توان لیزر، همپوشانی خطوط تابش داده شده با لیزر و سرعت پایش لیزر، به ترتیب بر مقاومت الکتریکی و ریخت شناسی سطح استفاده شد. نتایج نشان دهنده تشکیل گرافن متخلخل با ساختارهای مختلف بر روی سطح با استفاده از فرآیند القای لیز ری گرافن است. کمینه مقاومت الکتریکی ۱۰ اهم با شرایط تابش مشخص بدست آمد. با این حال، از آنجایی که ریخت شناسی سطح کمیت مهمی در کیفیت الکترودها در بسیاری از کاربردها چون دستگاههای ذخیرهساز انرژی است، و با توجه به نتایج این پژوهش، باید شرایط تابش را برای ایجاد الکترود با توجه به کاربرد مورد نظر بهینه کرد. **واژ گان سکیدی**: القای لیز ری، الکترو د گرافنه، پله ایمید ، لیز ر<sub>مو</sub>

۱ دانشیار، پژوهشکده فوتونیک و فناوریهای کوانتومی، پژوهشگاه علوم و فنون هستهای، تهران، ایران. (نویسنده مسئول) (رایانامه: hpazokian@aeoi.org.ir)

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup> استادیار، دانشکده فیزیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران. (رایانامه: <u>m.bahreini@iust.ac.ir</u>)

<sup>&</sup>lt;sup>۳</sup> دانشجوی دکتری، دانشکده فیزیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران. (رایانامه: <u>(fatemeh.rajabi7979@gmail.com</u>)

۱. مقدمه از زمان کشف گرافن و یتانسیل های الکتریکی و مکانیکی آن از حدود ۱۰ سال پیش تلاش های زیادی برای استفاده از آن در فناوری های آینده شده است [۶-۱]. گرافن در حقیقت اتم های کربن در یک شبکه لانه زنبوری در لایهای به ضخامت یک اتم است که با توجه به ویژگی های شگرف، و انایی استفاده در سیاری از کاربردها مثل ساخت الکترودها، حسگرها، ترانزیستورها و سیاری موارد دیگر را دارد [۹–۷]. از طرفی با پیشرفت فناوری استفاده از ابزارهای انعطاف یذیر و نیز کوچک سازی در صنایع مختلف از جمله ابزارهای پوشیدنی و حسگرهای زیستی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. گرافن به دلیل ویژگی های الکتریکی و مکانیکی خارقالعاده و همچنین با توجه به ابعاد آن پتانسیل زیادی برای ساخت الکترودها در چنین کاربر دهایی دارد. استفاده از گرافن در حسگرهای حرکت، زیستی و حسگرهای گاز بارها گزارش شده است. باتریها مثال مهم دیگری برای استفاده از گرافن هستند و پیش بینی شده است که گرافن بتواند در آینده جایگزین مناسبی برای باتریهای لیتیوم یونی باشد [۱۰] امروزه روش های مختلفی برای تولید گرافن وجود دارد. اگرچه، به صورت کلی چهار روش برای ساخت الكترودهاي گرافني انعطاف پذير ارائه شده است. اين روش ها شامل روش سنتز آلي، لايه-برداری اکسید گرافن، رسوب بخار شیمیایی و رشد همبافته است [۱۱]. با این حال این روش ها دارای نقصهایی مانند نیاز به انرژی زیاد، بازده پایین، هزینه بالا و آلودگی محیطی هستند که کاربردهای صنعتی آنها را محدود می کند. به عنوان مثال، گرفن ایجاد شده بالایهبرداری مکانیکی، رسانایی بسیار بالایی دارد اما از لحاظ اندازه کوچک بوده و دارای شکل نامنظ است. روش القای لیزری گرافن یکی از روش هایی است که از سال ۲۰۱۴ برای ایجاد آگرافن روی فیلم-های ناز ک پلیمری ارائه شده است [۱۲]. لیز ر مورد استفاده در این فر آیند لیز ر گاز کربنیک با طول-موج ۱۰.۶ µm بود. در این روش فیلمهای قابلانعطاف پلیمری شامل حلقههای کربنی به ویژ<u>ه</u> یلی ایمید با استفاده از لیزر و تحت شرایط ویژه مورد تابش قرار گرفته می شود. به این ترتیب در نواحی تابش دیده، لایه متخلخل گرافن ایجاد می شود که دارای ویژگی های منحصر به فرد برای ساخت الکترودهای مورد استفاده در حسگرها، ابرخازنها و غیره است. این فر آیند امروزه جهت ساخت الکترودها در ابزارهای مختلف از جمله ابزارهای ذخیره انرژی و حسگرها بسیار مورد توجه

است. این موضوع به دلیل سادگی و هزینه کم این فرآیند نسبت به سایر فرآیندها برای ایجاد

الکترودهای گرافنی بوده و از زمان کشف این فرآیند مواد مختلفی از پارچه تا کاغذ برای این کار استفاده شدهاند [۱۳و ۱۴].

با توجه به فرآیندهای در گیر در القای لیزری گرافن، لیزرهایی با طولموجهای متفاوت از مرئی و فرابنفش تا مادون قرمز توانایی ایجاد گرافن با فرآیند القای لیزری را دارند. با این حال کیفیت و روش ایجاد گرافن در آنها می تواند تا حدودی متفاوت باشد. با این وجود، در اغلب گزارش های اعلام شده از لیزر CO2 با طولموج μm ۲۰۰۶ برای این فرآیند استفاده شدهاست. به همین منظور در این مقاله به بررسی ایجاد الکترودهای گرافنی روی پلیمر پلیایمید با استفاده از تابش لیزر با طول موج مرئی ۴۴۵ نانومتر پرداخته می شود. اثر کمیتهای مختلف تابش دهی شامل توان لیزر، میزان همپوشانی خطوط تابش دهی شده و سرعت پایش لیزر در ایجاد گرافن روی نمونه پلیایمید بررسی و بهینه شرایط تابش برای ایجاد الکترود مورد بررسی قرار می گیرد.

۲. چیدمان، مواد و روش آذمایش برای ساخت الکترود از فیلمهای پلی ایمبند با ضخامت ۶۰ میکرون استفاده شده است. نمونه با استفاده از زیرلایه روی لام میکروسکوپ محکم شده و با استفاده از اتانول تمیز شد. سپس با استفاده از یک لیزر دیود با طول موج mm ۶۴ که روی یک میز متحرک با توانایی جابه جایی در راستای X و Y قرار گرفته بود، با شرایط مختلف مورد تابش قرار داده شد. برای بررسی تاثیر کمیتهای تابش دهی بر ویژگی های گرافن ایجاد شده، نمونه های مستطول شکل با ابعاد 2m ۳×۱، با استفاده از توان، سرعت و تعداد خط تابش دهی شده در هر اینچ از عرض نمونه (در راستای Y) که معیاری بسیاری از انواع حسگرها دارای ساختار سه الکترودی هستند، تعدادی از شرایط آزمایش برای هر بسیاری از انواع حسگرها دارای ساختار سه الکترودی هستند، تعدادی از شرایط آزمایش برای هر بررسی تغییرات شیمایی و سه الکترودی) مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین با توجه به اینکه بررسی تغییرات شیمایی و سه الکترودی) مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین با توجه به اینکه مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور بررسی موار ال گرفت. پس از تابش دهی نمونه ها جهت بررسی تغییرات شیمایی و سه الکترودی) مورد بررسی قرار گرفت. پس از تابش دهی نمونه ها جهت مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور بررسی مقاومت الکتریکی الکتروهای ایجاد شده، مقاومت مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور بررسی مقاومت الکتریکی الکتروهای ایجاد شده، مقاومت مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور بررسی مقاومت الکتریکی الکتروهای ایجاد شده، مقاومت مولیمتر در نقاط مختلف سطح و با فاصله مشخص (حدود ایر از گرفته و مقاومت سطح ۵ بار در قسمتهای مختلف سطح و با فاصله مشخص (حدود ایر ازه گیری شد. بدین منظور پروب های بار در قسمتهای مختلف سطح و با خامای کمتر از ۱۰ اهم اندازه گیری شد. ۳. نتایج
۳. نتایج
جهت بررسی تاثیر کمیتهای تابش دهی بر ویژگیهای نمونه، نمونهها با توانهای مختلف لیزر
جهت بررسی تاثیر کمیتهای تابش دهی بر ویژگیهای نمونه، نمونهها با توانهای مختلف لیزر
۲۲۰، ۲۰، ۱.۲۵ و ۲ وات، سرعت اسکن ۱۳/۵ mm/۶ و میزان همپوشانی مختلف ۲۰۰، ۲۰۰ و
۲۳۰ خط در اینچ مورد تابش قرار گرفتند. شکل (۱) تصاویر تعدادی از نمونههای تابش دهی شده
برای ایجاد الکترود مستطیلی و ساختار سه الکترودی را نشان می دهد.



Fig. 1 Optical image of a rectangular electrode and three-electrode patterns created under different irradiation conditions.

شکل ۱ تصویر نوری از یک الکترود مستطیلی و الگوهای سه الکترودی ایجاد شده در شرایط مختلف تابش دهی. همان طور که در تصویر مشخص است، سطوح تعدادی از نمونهها بعد از تابش دهی کاملاً سیاه شده است. در حالی که سطح تعدادی از الگوها به صورت نایکواخت دچار تغییراتی شدهاند. میزان تغییرات ایجاد شده روی سطح نمونه به میزان زیادی به کمیتهای تابش دهی به ویژه توان لیزر و سرعت پایش نمونه دارد. در توانهای کمتر از ۱ وات، تابش لیزر در محدوده سرعتهای پایش مورد استفاده در این آزمایش، تنها منجر به ذوب نمونه می شود. این توان در حقیقت توان آستانه برای ایجاد گرافن روی سطح نمونه است. با این حال باید بیان داشت که با افزایش سرعت پایش، توان آستانه بالاتری برای ایجاد گرافن روی سطح نمونه می شود. این توان در حقیقت توان آستانه با افزایش توان لیزر و با ایجاد گرافن روی سطح نمونه، سطح شروع به سیاه شدن می کند. افزایش سطح نمونه شده و ذرات کنده شده در اطراف نمونه پخش می شود. برای بررسی تغییرات شیمیایی و ایجاد گرافن روی سطح نمونه، یک نمونه تابش دهی شده با برای بررسی تغییرات شیمیایی و ایجاد گرافن روی سطح نمونه، یک نمونه تابش دهی شده با مقاومت کم با طیفسنج رامان مورد بررسی قرار گرفت. شکل (۲)(الف و ب) به ترتیب طیف رامان و پراش پرتو ایکس گرفته شده از نمونه را نشان می دهد.



Fig. 2 (a) Raman spectrum, and (b) XRD spectrum taken from the sample irradiated at 1.75 W and scanning speed of 10 mm/s.

```
شکل ۲ (الف) طیف رامان و (ب) طیف XRD گرفته شده از نمونه تابش داده شده در توان W ۱.۷۵ و سرعت
۱۰ mm/s
```

همان طور که در طیف مشخص است، با تابش نمونه در توان W ۱.۷۵ قلّه گرافن در طول موجهای حدود ۱۳۶۰ دm<sup>-1</sup>، ۱۳۶۰ و یک قلّه پهن حول ۲۹۰۰ cm<sup>-1</sup>، که به ترتیب مربوط به قلّههای G، D و TD در گرافن هستند ایجاد می شود. بنابراین این طیف به روشنی ایجاد گرافن روی نمونه را نشان می دهد. نوار D بیانگر نقوص ایجاد شده در نمونه و نوار TD، اطلاعاتی از تعداد لایههای گرافن می دهد. هرچند شدت نوار D نشان دهنده ایجاد نقوص در نمونه است، اما پایین بودن نسبت

(1)

شدت D به G نشان دهنده کیفیت مناسب گرافن ایجاد شده است. از طرفی پهن بودن قلّه TD و نیز نسبت شدت قلّه TD به G که حدود ۸۵ است، بیانگر ایجاد گرافن چندلایه روی سطح و نوار G بیانگر ارتعاشات کششی پیوند SP<sup>2</sup> اتمهای کربن است. همچنین همان طور که شکل (۲- ب) نشان می دهد، طیف XRD نمونه تابش داده شده دارای یک قلّه تیز در ۲۵۸<sup>0</sup> و یک قلّه پهن با شدت پایین در حدود ۳۵۰ است. قلّه اول مربوط به صفحات گرافن با شبکه بلوری ۲۰۰ و با فاصله تقریبی ۲۳. آنگستروم و نشان دهنده درجه بالا گرافیت شدن نمونه، و پیک دوم در اثر ناخالصی های موجود در نمونه از جمله ذرات فیلم پلی ایمید است. از طرفی تقارن قلّه ۲۰۰ با دنباله در زوایای کمتر از ۲۵۸<sup>0</sup> بیانگر افزایش فاصله لایههای گرافنی است که به دلیل پخش شدن نقوص در لایههای شش ضلعی گرافن ایجاد شده است [۱۲]. اندازه بلوری در امتداد محور ۲۰۰ با استفاده از رابطه (۱)

 $L_{002} = \frac{0.89\,\lambda}{B_{1/2(2\theta)Cos(\theta)}}$ 

که در آن،  $\lambda$  طول موج پر تو X، ۱.۵۴ آنگستروم و (20)  $B_{1/2}$  بر حسب رادیان، پهنای قلّه ۲۰۰ در بیشینه موثر است [۱۲]. با استفاده از طیف XRD،  $L_{002}$  حدود  $\lambda$  نانومتر بدست می آید. باید بیان داشت که طیف XRD نمونه های با مقاومت بالاتر (در اینجا نشان داده نشده است)، شامل قلّه هایی در محدوده ۲۱۳–۱۰ که بیانگر ایجاد اکسید گرافز در نمونه است. به منظور بررسی مقاومت الکتریکی الکترودهای ایجاد شده، مقاومت نمونه ها پس از تابش دهی با استفاده از مولتی متر اندازه گیری شد. شکل (۳) (الف و ب) به ترتیب نمودار تغییرات مقاومت نمونه بر حسب توانها در همپوشانی های مختلف، و سرعت های پایش مختلف نشان می دهد:



per inch,

and (b) scanning speed at two different laser powers.

**شکل ۳** نمودار مقاومت نمونهها بر حسب (الف) توان لیزر برای تعداد خط در اینچ متفاوت و (ب) سرعت پایش در دو توان مختلف.

فیلم پلی ایمید قبل از تابش دهی کاملاً نارسانا بوده و مقاومت آن بیش از ۹۰ مگا اهم پر سانتی متر مربع است. با تابش دهی نمونه با توان ۱ وات با میزان متفاوت از همپوشانی خطوط لیزر، تغییری در مقاومت نمونه ایجاد نمی شود. در حالی که با افزایش توان لیزر به ۱.۵ وات، مقاومت نمونه به شدت کاهش یافته و به حدود ۷۰۰ اهم می رسد. میزان این کاهش به میزان همپوشانی خطوط لیزری نیز بستگی داشته و با افزایش میزان همپوشانی بیشتر است. به صورتی که افزایش تعداد خطوط لیزر به میزان ۲۰ خط در اینچ، سبب کاهش ۱۰۰ اهمی در مقاومت نمونه می شود. افزایش بیشتر توان لیزر سبب کاهش بیشتر مقاومت و رسیدن آن به حدود ۲۳۰ اهم می شود. با افزایش میزان همپوشانی، مقاومت ابتدا تا حدی افزایش و سپس کاهش می یابد. کاهش مقاومت با افزایش توان ادامهدار نبوده و با افزایش توان به ۲ وات مقاومت نمونه شروع به افزایش کرده و دوباره مقاومت نمونه با افزایش همپوشانی ابتدا افزایش و سپس کاهش می یابد. با این حال میزان تغییرات مقاومت در این توان بسیار پیشتر و حدود ۹۰۰ اهم است. این موضوع نشان دهنده اهمیت توان لیزر به عنوان کمیت اساسی در کاهش مقاومت نمونه می باشد.

از طرفی همان طور که در شکل (۳- ب) مشخص است، تغییرات مقاومت نمونه به سرعت پایش نیز بستگی دارد. هرچند در نگاه اول در توان های بالاتر می توان با سرعت های پایش بیشتر مقاومت نمونه را کاهش داد، با این حال این کاهش مقاومت با تغییرات سرعت در توان های مختلف رفتار یکسانی را از خود نشان می دهد. به عنوان مثال، همان طور که در نمودار مشخص است، در سرعت ثابت Vmm/s تابش نمونه با توان بالاتر منجر به کاهش مقاومت نمونه تا ۱۲۰ اهم شده است، در حالی که در توان حدود ۱۰٪ پایین تر مقاومت نمونه حدود ۹۰۰ اهم است. با افزایش سرعت مقاومت در نمونه تابش داده شده با توان W ۲۰۱ کاهش می یابد، اما مقاومت نمونه تا ۱۲۰ اهم مقاومت در نمونه تابش داده شده با توان W ۲۰۱ کاهش می یابد، اما مقاومت نمونه تا ۱۲۰ اهم مقاومت در نمونه تابش داده شده با توان W ۲۰۱ کاهش می یابد، اما مقاومت نمونه تابش داده شده با توان کمتر افزایش می یابد. این رونه تغییر مقاومت با سرعت پایش تا سرعت حدود ۱۴ ادامه داشته و در سرعتهای بالاتر معکوس می شود. تفاوت مورفولوژی روی سطح در توان های مختلف و نیز افزایش توان آستانه مورد نیاز برای ایجاد گرافن روی سطح با افزایش سرعت یا یش

همان طور که اشاره شد، ریخت شناسی سطح الکترود یکی از کمیت های مهم در بکار گیری آن در کاربردهای مختلف به ویژه ابزارهای ذخیره انرژی است. به منظور بررسی ساختار ایجاد شده و تغییرات ریخت شناسی روی سطح نمونه بعد از تابش در توان های مختلف، تعدادای از نمونه های با مقاومت پایین با استفاده از میکروسکوپ الکترونی مورد بررسی قرار گرفتند. شکل (۴) تصاویر میکروسکوپ الکترونی نمونه های تابش داده شده در توان ۱.۵۵ و ۲ وات را نشان می دهد.



همان طور که از تصاویر مشخص است، در اثر تابش نمونه در توان ۱۹ وات، مواد از سطح نمونه کنده شده و در اثر این کندگی ساختار لانه زنبوری در ابعاد زیر ۵ میکرون روی سطح نمونه ایجاد شده است. این ساختار کاملاً متخلخل بوده و به صورت کمابیش یکنواخت روی سطح پخش شده است. با افزایش توان لیزر در ۱.۷۵ وات حفره های میکرونی با ابعاد ۵-۱ میکرون در نقاطی از سطح ایجاد شده و ذرات زیرمیکرونی در کل سطح دیده می شوند. ایجاد حفره های میکرونی روی سطح نمونه می تواند ناشی آزاد شدن گاز حین شکستن و بازتر کیب پیوندها در نمونه در اثر برهم کنش با لیزر باشد. به عبارت دیگر تابش لیزر سبب پیرولیز آنی پیش ساز و در نتیجه شکستن و ترکیب دوبارهی پیوندهای شیمیایی و آزاد شدن گاز می شود. افزایش بیشتر توان تا ۲ وات منجر به کندگی وسیع در سطح نمونه شده و در اثر این کندگی مواد کنده شده روی سطح نمونه پخش شده و ساختاری غیر یکنواخت روی نمونه ایجاد شده است.

الکترودها از اجزاي حياتي در فر آيندهاي الکتروشيميايي بوده و ماهيت و عملکر د آنها نقش اساسي در به کار گیری آن ها دارند. برخی از الکترودها مثل فولاد ضد زنگ و گرافیت سرب مدادی ارزان قیمت هستند، در حالی که برخی دیگر گران بوده و به ساختار پیچیدهای نیاز دارند. به همین دلیل ساخت الكترودهاي ارزان قيمت بسيار مورد توجه يژوهشگران بوده است [1۵]. از طرفي همان طور که در مقدمه بیان شد. امروزه الکترودهای گرافنی با توجه به مزایای زیاد بسیار مورد توجه قرار دارند. با این حال هزینه بالای تولید گرافن مانع از پیشرفت مناسب در این حوزه شده است. برهم-کنش لیزر با ماده به منظور ایجاد ویژگیهای منحصر به فرد روی سطح نمونه از زمان ساخت لیزر بسیار مورد توجه بوده است و پژوهشگران بسیاری در این زمینه به بررسی نوع برهم کنش لیزر با ماده در رژیمهای مختلف تابش پرداختهاند [۱۹–۱۶]. به صورت کلی برهم کنش لیزر با ماده منجر به دو فرآیند فتوحرارتی یا فتوشیمیایی و یا ترکیب هر دو فرآیند میشود. نوع این برهمکنش به ویژه به طولموج لیزر مورد استفاده و میزان جذب ماده مورد نظر در طولموج لیزر دارد. لیزرهای با طولموج کوتاه معمولا از راه فرآیندهای فتوشیمیایی با نمونه برهم کنش می کنند، در حالی که فرآيند غالب در برهم كنش ماده با طول موجهاي بلند در محدود مادون قرمز فرآيند حرارتي است. در فرآیند فتوشیمیایی برهم کنش لیزر با ماده به دلیل انرژی کافی فوتون، پیوندهای کوالانسی به صورت مستقیم شکسته می شوند. اما در فرآیندهای حرارتی، برهم کنش لیزار از راه افزایش ارتعاشات در پیوندها با انتقال حرارت منجر به شکستن پیوند می شود. افزایش دما در برهم کنش های حرارتی درطولموج مادون قرمز بسیار زیاد بوده و دما در این فرآیند به صورت محلی و جایگزیده تا چند هزار درجه سانتی گراد افزایش می یابد. این افزایش دما برای شکستن پیوندهای کربی موجود در یلی ایمید کافی بوده و به آسانی منجر به شکستن آن ها می شود [۲۰]. حین فر آیند القای لیزری گرافن در اثر برهم کنش فیلم پلی ایمید با لیزر، بسیاری از پیوندهای C=O، C-O و N=C در پلی ایمید شکسته شده و بعد از بازترکیب به صورت گاز آزاد شده و نانوصفحات گرافن متخلخل با ساختار شبکههای هفتضلعی و شش ضلعی متشکل از بیش از ۸۵ درصد کربن تولید

می کنند [۹, ۱۱]. بازتر کیب این پیوندها منجر به تشکیل و ایجاد ساختار گرافنی می شود. با این حال ساز و کار تشکیل گرافن القا شده با لیزر (LIG) با توجه به طول موج لیزر مورد استفاده متفاوت است. در مورد تابش لیزر مادون قرمز، اثر فتوحرارتی برای توضیح انتقال انرژی پیشنهاد شده است. از سوی دیگر، لیزر ماوراء بنفش به احتمال زیاد سبب ایجاد یک فرآیند فتوشیمیایی می شود. در مورد لیزر مرئی که در این آزمایش از آن استفاده شده است، هر دو اثر فتوحرارتی و فتوشیمیایی به تشکیل بیزر مرئی که در این آزمایش از آن استفاده شده است، هر دو اثر فتوحرارتی و فتوشیمیایی به تشکیل به صورت فتوحرارتی و به میزان کمتر فتوشیمیایی به اتمهای کربن SP<sup>2</sup> تبدیل می شوند.

صرف نظر از طول موج لیز ر مورد استفاده برای ایجاد گرافن روی نمونه، کمیت های تابش دهی شامل توان لیزر، سرعت پایش لیزر با نمونه و میزان همپوشانی خطوط تابش دهی شده تاثیر زیادی روی کیفیت و میزان گرافن ایجاد شده روی نمونه و درنتیجه عملکرد الکترودهای ایجاد شده دارند. بنابراین با توجه به امکان تغییر و تنظیم کمیتهای تابش دهی در فر آیند القای لیزری گرافن، کنترل ویژگیهای سطح الکترود فر آیندی ممکن و قابل توجه است. در این پژوهش کمینه مقاومت بدست آمده با تنظیم کمیتهای تابشدهی حدود ۸۰ اهم است که مربوط به نمونه تابش دادهشده در توان ۲ W با سرعت ۱۵ mm/s و تعداد ۲۰۰ خط در هر اینچ از عرض نمونه می باشد. این مقاومت برای استفاده از الکترود در ایزارهای ذخیره انرژی و حسگرها مناسب بوده و هزینه تولید بسیار کمی دارد. از طرفي نتايج اين يژوهش نشان مي دهد كه تغييرات ريخت شاسي سطح الكترود كه كميت مهم دیگری در عملکرد الکترود است، می تواند رفتار متفاوتی با تغییرات مقاومت الکتریکی در شرایط مختلف تابش دهی داشته باشد. با توجه به نتایج بدست آمده از تصاویر میکروسکوپ الکترونی در شکل (۴) و مقایسه میزان مقاومت بدست آمده برای نمونه های تابش داده شده در توان های مختلف و با سرعت اسکن و همیوشانی یکسان (به تر تیب ۱۰ mm/s و ۲۰۰ خط در اینچ)، سطح نمونه تابش داده شده با توان W ۱.۵ و ۲W نسبت به نمونه تابش داده شده در توان ۱.۷۵W دارای ساختار متخلخل متفاوت و با وسعت بیشتری است. همچنین تخلل ایجاد شده در نمونه تابش دادهشده در توان W ۱.۵ بسیار یکنواخت تر از نمونه تابش داده شده در توان W ۲ و مقاومت نمونه تابش داده شده با توان ۱.۷۵ وات از دو نمونه دیگر کمتر است. این تغییرات تاثیر زیادی روی عملکر د الکترود داشته و بنابراین انتخاب شرایط تابشدهی و همچنین رقابت بین این دو کمیت با توجه به کاربرد مورد نظر بسيار مهم خواهد بود.

۸. نتیجه گیری در این مقاله الکترودهای گرافنی با استفاده از فرآیند القای لیزری گرافن با استفاده از لیزر mn در این مقاله الکترودهای گرافنی با استفاده از فرآیند فیلم پلیایمید با استفاده از لیزر در شرایط مختلف، تابش دهی و مورد بررسی قرار گرفت. کمینه مقاومت بدست آمده با تغییر توان، میزان همپوشانی خطوط تابش دهی (تعداد خط در هر اینچ از مساحت ثابتی از نمونه) و سرعت پایش، ۸۰ اهم است. با این حال نتایج نشان می دهد که تغییرات ریخت شناسی سطح نمونه و به عبارت دیگر افزایش سطح موثر ایجاد شده روی الکترود در اثر ایجاد ساختار متخلخل لزوماً با کاهش مقاومت در یک راستا نیمتند. بنابراین لزوم بررسی و بهینه سازی هر کدام از این عوامل برای کاربرد مورد

نظر ضروري است.

برخود لازم می دانیم از رحمات و همکاری جناب آقای محسن منتظر القائم در انجام آزمایش ها

مراجع

[1] Li, X., Yu, J., Wageh, S., Al-Ghamdi, A.A. and Xie, J., "Graphene in photocatalysis: a review," *Small*, 12(48), 6640-6696, 2016. https://doi.org/10.1002/smll.201600382.

[2] Stoller, M.D., Park, S., Zhu, Y., An, J. and Ruoff, R.S., "Graphene-based ultracapacitors," *Nano letters*, 8(10), 3498-3502, 2008. https://doi.org/10.1021/nl802558y.

[3] Berry, V., "Impermeability of graphene and its applications," *Carbon*, 62, 1-10, 2013. https://doi.org/10.1016/j.carbon.2013.05.052.

[4] Zhang, Z., Zhu, H., Zhang, W., Zhang, Z., Lu, J ,Xu, K., Liu, Y., and Saetang, V., "A review of laser-induced graphene: From experimental and theoretical fabrication processes to

emerging applications," *Carbon,* 214, 118356, 2023. https://doi.org/10.1016/j.carbon.2023.118356.

[5] Avinash, K. and Patolsky, F., "Laser-induced graphene structures: From synthesis and applications to future prospects," *Materials Today*, 70, 104-136, 2023. https://doi.org/10.1016/j.mattod.2023.10.009.

**[6]** Thaweeskulchai, T., Sakdaphetsiri, K., and Schulte, A., "Ten years of laser-induced graphene: Impact and future prospect on biomedical, healthcare, and wearable technology," *Microchimica Acta*, 191, 292, 2024. https://doi.org/10.1007/s00604-024-06350-z.

[7] Tan, R. K. L., Reeves, S. P., Hashemi, N., Thomas, D. G., Kavak, E., Montazami, R., and Hashemi, N. N", Graphene as a flexible electrode: review of fabrication approaches," *Journal* 

of Materials Chemistry A, 5, 17777-17803, 2017. https://doi.org/10.1039/C7TA05759H.

[8] Burke, M., Larrigy, C., Vaughan, E., Paterakis, G., Sygellou, L., Quinn, A. J., Herzog, G. g., Galiotis, C., and Iacopino, D., "Fabrication and electrochemical properties of threedimensional (3D) porous graphitic and graphenelike electrodes obtained by low-cost direct laser writing methods," ACS omega, 5, 1540-1548, 2020. https://doi/full/10.1021/acsomega.9b03418.

[9] Yoon, H., Nah, J., Kim, H., Ko, S., Sharifuzzaman, M., Barman, S. C., Xuan, X., Kim, J., and Park, J. Y., "A chemically modified laser-induced porous graphene based flexible and ultrasensitive electrochemical biosensor for sweat glucose detection," *Sensors and Actuators B: Chemical*, 311, 127866, 2020. https://doi.org/10.1016/j.snb.2020.127866.

[10] Raccichini, R., Varzi, A., Wei, D., and Passerini, S., "Critical insight into the relentless progression toward graphene and graphene-containing materials for lithium-ion battery anodes," *Advanced materials*, 29(11), 1603421, 2017. https://doi.org/10.1002/adma.201603421.

[11] Wang, L., Wang, Z., Bakhtiyari, A. N., and Zheng, H., "A comparative study of laserinduced graphene by CO2 infrared laser and 355 nm ultraviolet (UV) laser," *Micromachines*, 11(12), 1094, 2020. https://doi.org/10.3390/mi11121094.

[12] Lin, J., Peng, Z., Liu, Y., Ruiz-Zepeda, F., Ye, R., Samuel, E. L., Yacaman, M. J., Yakobson, B. I., and Tour, J. M., "Laser-induced porous graphene films from commercial polymers," *Nature communications*, 5(1), 5714, 2014. https://doi.org/10.1038/ncomms6714.

[13] Chyan, Y., Cohen, J., Wang, W., Zhang, C., and Tour, J. M., "Graphene Art," ACS Applied Nano Materials, 2(5), 3007-3011, 2019. https://doi/abs/10.1021/acsanm.9b00391.

[14] Han, X., Ye, R., Chyan, Y., Wang, T., Zhang, C., Shi, L., Zhang, T., Zhao, Y., and Tour, J. M., "Laser-Induced Graphene from Wood Impregnated with Metal Salts and Use in Electrocatalysis," *ACS Applied Nano Materials*, 1(9), 5053-5061, 2018. https://doi/abs/10.1021/acsanm.8b01163.

[15] Shokurov, A. V. and Menon, C", Laser-Induced Graphene Electrodes for Electrochemistry Education and Research," ed: ACS Publications, 2023.

https://doi.org/10.1021/acs.jchemed.2c01237.

[16] Mulser, P. and Bauer, D., "High power laser-matter interaction", *Springer Science & Business Media*, 238, 2010. 10.1007/978-3-540-46065-7.

[17] Yin, J., Yang, L., Yang, X., Zhu, H., Wang, D., Ke, L., Wang, Z., Wang, G., and Zeng, X., "High-power laser-matter interaction during laser powder bed fusion," *Additive Manufacturing*, 29, 100778, 2019. https://doi.org/10.1016/j.addma.2019.100778.

[18] Kumar, A., Pathak, A., Kumar, A., and Kumar, A., "Physics of laser-matter interaction in laser-based manufacturing," in *Laser-based technologies for sustainable manufacturing*, ed: CRC Press, 45-54, 2023.

[19] Malik, H. K., *Laser-matter interaction for radiation and energy*: CRC press, 2021. https://doi.org/10.1201/b21799.

[20] Dreyfus, R., "CN temperatures above laser ablated polyimide," *Applied Physics A*, 55, 335-339, 1992. https://doi.org/10.1007/BF00324081.